

## 유기박막의 파괴전압과 전기특성

송진원\*, 강용철\*\*, 김형곤\*\*\*, 이우선\*\*\*\*, 정현상\*\*\*\*\*, 장희동\*\*\*\*\*\*, 이경선\*\*\*\*\*

\* 동신대학교 대학원 전기전자공학과

\*\* 광주보건대학 의용공학과

\*\*\* 조선이공대학 전기과

\*\*\*\* 조선대학교 공과대학 전기공학과

\*\*\*\*\* 동신대학교 공과대학 전기전자공학부

### Breakdown Voltage and Electrical Characteristics of Organic Thin Film

Jin-Won Song\*, Yong-Chul Kang\*\*, Hyung-Gon Kim\*\*\*, Woo-Sun Lee\*\*\*\*,

Hun-Sang Chung\*\*\*\*, Hee-Dong Chang\*\*\*\*\*, Kyung-Sup Lee\*\*\*\*\*

\* Dept. of Electrical and Electronic Eng. Dongshin University grad.

\*\* Dept. of Medical Eng. Kwang-Ju Health College

\*\*\* Dept. of Electrical of Chosun Scientific & Technology College

\*\*\*\* Dept. of Electrical Eng. Chosun University

\*\*\*\*\* Dept. of Electrical and Electronic Eng. Dongshin University

**Abstract** - We give pressure stimulation into organic thin films and then manufacture a device under the accumulation condition that the state surface pressure is 30(mN/m). LB layers of Arac. acid deposited by LB method were deposited onto y-type silicon wafer as Y-type film. In processing of a device manufacture, we can see the process is good from the change of a surface pressure for organic thin films and transfer ratio of area per molecule.

The structure of manufactured device is Au/arachidic acid/Al, the number of accumulated layers are 9~21. Also, we then examined of the MIM device by means of I-V. The I-V characteristic of the device is measured from -3 to +3[V]. The insulation property of a thin film is better as the distance between electrodes is larger.

### 1. 서 론

분자 설계에 따라 무한의 구조를 얻을수 있는 유기재료를 이용한 초박막 기능성 소자의 연구가 관심을 받고 있는데, 유기재료를 이용한 유기박막은 분자 레벨의 기능성 소자로서 전력기기 제작등에 응용할 수 있으며, 박막을 구성하고 있는 분자들을 규칙적으로 배열, 배향할 수 있다는 장점이 있기 때문에 최근 광도전 소자, 액정소자, 유전체 및 절연소자등 여러 기능성 소자로서의 응용에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다.<sup>1)-3)</sup>

Langmuir - Boldgett(LB)법은 수면위의 유기단분자막을 일정한 압력으로 압축하여 안정된 단분자막을 형성하고, 이 단분자막을 고체 기판위에 단층 또는 다층으로 누적하는 기술로서 방향성이 우수한 분자막을 형성할 수 있다고 알려져 있으며, 특히 상온·상압하에서 저에너지로 박막의 제작이 가능하여 신소재응용기술로서 각광을 받고 있다. LB법에 의해 제작된 LB박막은 그 누

적 형태에 따라 X type, Y type, Z type으로 구분된다.<sup>4)-5)</sup>

본 연구에서는 Arachidic acid를 이용, Y type으로 9~21층으로 제막하여 Cr/Au/ Arachidic acid / Al의 MIM(Metal-Insulator-Metal)소자를 제작하고, 절연파괴전압의 경향과 그 전기적 특성을 검출하여 보았다.

### 2. 본 론

#### 2.1 실험

그림 1은 본 연구에 사용된 Arachidic acid의 분자구조이다. Arachidic acid는  $CH_3(CH_2)_{18}COOH$ 의 소수기와  $COOH$ 의 친수기를 갖는 양친매성 물질로서, chloroform을 용매로 하여 0.5mmol/l로 조성하였고, pH 6.0인 20°C의 초순수(18.2MΩcm)에 전개하였다.

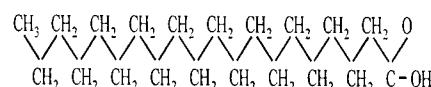


그림 1. 분자구조

Fig. 1. Molecule structures

그림 2는 /Au/Arachidic acid/Al의 MIM구조이다. 사용된 기판은 Si wafer( $13 \times 38 \times 1\text{mm}$ )이며, 하부전극으로는 Cr과 Au를  $2.1 \times 10^{-5}$  torr에서 증착하였다. 수면위에 시료를 전개한후 약 10분정도의 안정시간을 유지한후 barrier speed 20mm/min, dipper speed up - 2mm/min, down - 5mm/min의 속도로 압축하여 제막하였으며 Y type으로 Si 기판에 9~21층 누적하였다. 상부전극으로는 Al을 증착하였다.

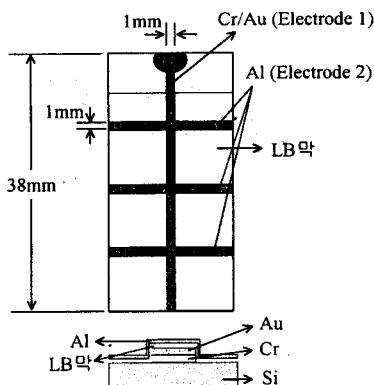


그림 2. MIM 구조  
Fig. 2. Structure of MIM

누적된 LB 막의 I-V 측정은 Keithley 6517 electrometer를 사용하여 측정하였으며, 캐퍼시터의 정전용량은 LF impedance analyzer(HP 4192A)를 사용하여 주파수 100[kHz]에서 측정하였다.

## 2.2 결과 및 고찰

그림 3은 LB 막 누적조건을 위한 제막조건을 결정하기 위하여 Arachidic acid 단분자를 수면위에 전개시켜 barrier를 압축시켰을 때 분자 점유면적에 따른 표면압의 변이결과이다.

분자의 점유면적은  $56\text{ }\text{\AA}^2 \sim 19\text{ }\text{\AA}^2$  부근까지 압축하였으며,  $30\text{ [mN/m]}$ 를 제막조건으로 결정하였다.

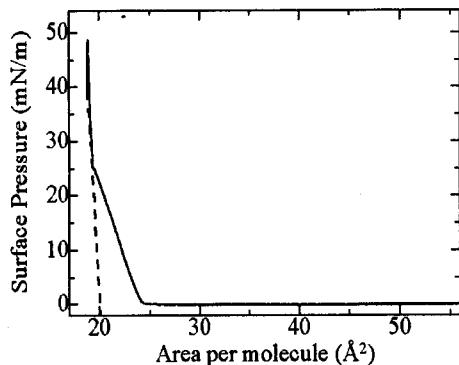


그림 4.  $\pi$ -A 곡선  
Fig. 4.  $\pi$ -A isotherm

그림 5는 Y-type으로 20층을 제막하였을 때 시간에 따른 표면압과 분자당 점유면적을 측정한 것이다. 제막 조건인  $30\text{ [mN/m]}$ 까지 압축을 하였으며 표면압이 제막조건에 가까워지면서 정밀하게 조절되어 과정을 거쳐 dipper가 up, down stroke 동작을 하면서 기판으로 분자들이 전이되어 가는 것을 볼 수 있다. 수면 위에서

분자당 점유면적의 감소형태가 선형적으로 나타나는 것을 보아 유기단분자막이 기판에 잘 전이되었음을 알 수 있었다.

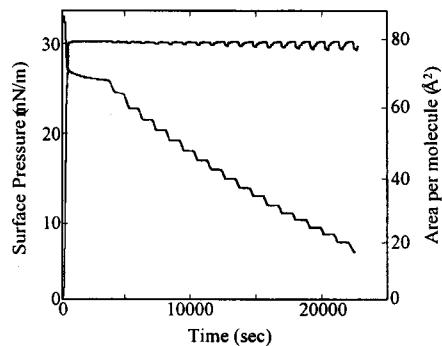


그림 5. 누적전이비  
Fig. 5. Deposition of transfer ratio

그림 6은 Y-type으로 각각 8층, 12층, 16층, 21층 누적한 Cr/Au/Arachidic acid/Al 디바이스에 전압을 인가하여 검출된 I-V 특성이다. 제작된 디바이스에  $-3 \sim +3\text{ [V]}$  범위에서  $0.1\text{ [V]}$ 씩 승압, 감압하면서 측정하였으며, 전압의 인가시 전하의 축적에 기인한 누설전류 및 절연저항 등을 고려하여 1분 정도의 시간이 지난 후 전류를 측정하였다.

그림에서 인가전압에 대해 전류값은 누적충수가 많을수록 동일한 인가전압에서 발생하는 전류의 크기가 적게 나타남을 알 수 있었다. 또한 누적충수가 적을수록 지수함수적으로 전류가 증가하였으나 두께가 커지면 곡선은 직선적인 ohmic 특성을 나타내었다. 이는 LB 막의 누적충수가 증가할수록 저항이 증가한다는 것을 나타내며 두께가 증가하여 전극간의 거리가 멀어질수록 더 높은 전계에서도 파괴되지 않는 절연특성을 나타내고 있다.

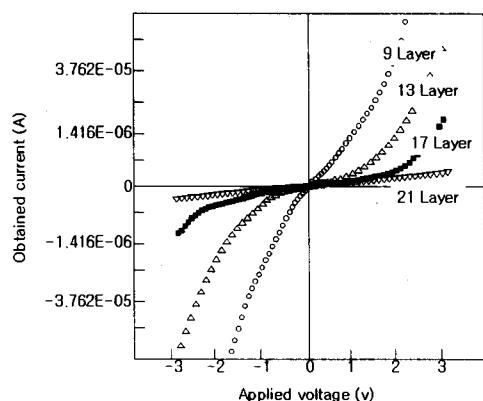


그림 6. I-V 특성  
Fig. 6. I-V characteristics

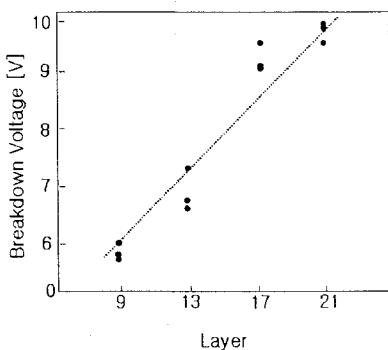


그림 7. 절연파괴전압  
Fig. 7. Breakdown voltage

그림 7은 제작된 LB박막의 누적층수에 따른 절연파괴전압을 측정한 결과이다. 누적층수가 많을수록 절연파괴전압은 높게 나타났으며, 절연파괴전압은 누적층수에 비례하여 증가함을 알수 있었다.

그림 8은 주파수가 100kHz일 때 유기단분자막의 누적층수에 따른 정전용량이다. 누적층수가 증가함에 따라 정전용량은 감소함을 볼 수 있었고, 이는 이론식과 잘 일치함을 알 수 있었다.

$$C = \frac{S}{d} \epsilon_0 \epsilon_r \quad (S: \text{면적}, d: \text{거리})$$

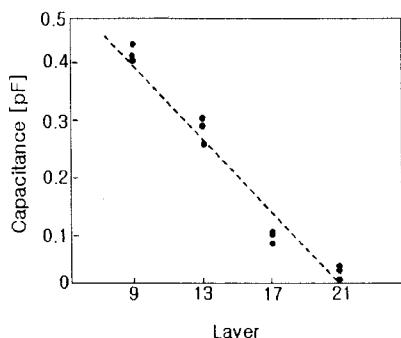


그림 8. 정전용량특성  
Fig. 8. Capacitance properties

### 3. 결 론

본 연구에서는 Arachidic acid를 이용하여 Y-type으로 9~21층의 MIM디바이스를 제작하여 그 전기적 특성을 검출하였다.

- 1) L막에 압력자격을 인가하여 누적조건으로 30[mN/m]를 결정하였다. 검출된 제막조건에 의하여 제막하였고 누적막 전이비로 보아 제막상태가 양호함을 알 수 있었다.
- 2) 제작된 MIM디바이스에 인가전압에 따른 전류를 측정한 결과 누적층수가 많을수록 전류의 크기가 적게 나타남을 알 수 있었고, 두께가 증가하여 전극간의 거리가 멀어질수록 더 높은 전계에서도 파괴되지 않는 절연특성을 나타내고 있다.
- 3) 절연파괴전압은 누적층수에 비례하여 선형적으로 증가하였으며, 누적층수가 증가할수록 절연저항이

더 증가함을 알 수 있었다.

- 4) 캐퍼시티의 정전용량은 누적층수가 적을수록 크게 나타났는데 이는 이론식과 잘 일치함을 알 수 있었다.

### (참 고 문 헌)

- [1] G.Roberts, "Langmuir-Blodgett Films", Pleum, New York, 1990
- [2] Keiji Ohara and Masaaki Nakajima, "Displacement current generated during compression of fatty acid and phospholipid monolayers at the water-air interface", Thin Solid Films, 226, pp. 164-172, 1993
- [3] Mitsumasa Iwamoto and Tohru Sasaki, "Thermally Stimulated Discharge of Au/LB/Air-Gap/Au Structures Incorporating Cadmium Arachidate Langmuir-Boldgett Films", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 29, No. 3, pp. 536~539, 1990
- [4] A.Miller, C.A.Helm and H.Mohwald, "The Colloidal Nature of Phospholipid Monolayers.", J.Physique, 48, pp. 693-701, 1987
- [5] Mitsumasa Iwamoto and Shun-ichi Shidoh, "Electrical Properties of Au/Polyimide/Squarylium-Arachidic Acid Junction Fabricated by the Langmuir-Boldgett Technique", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 29, No. 10, pp. 2031~2037, 1990